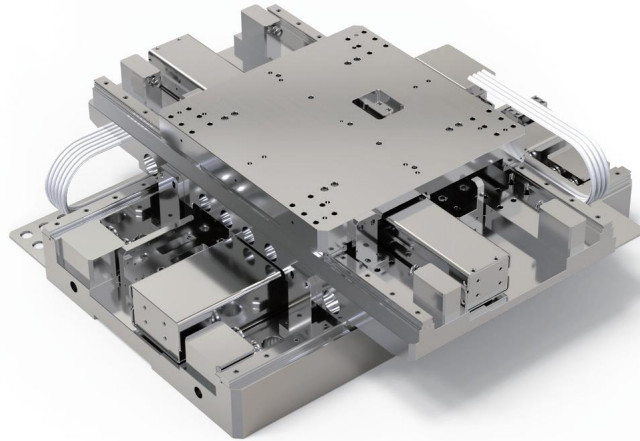


## VLS200系列——高真空精密二维位移台

### 产品描述

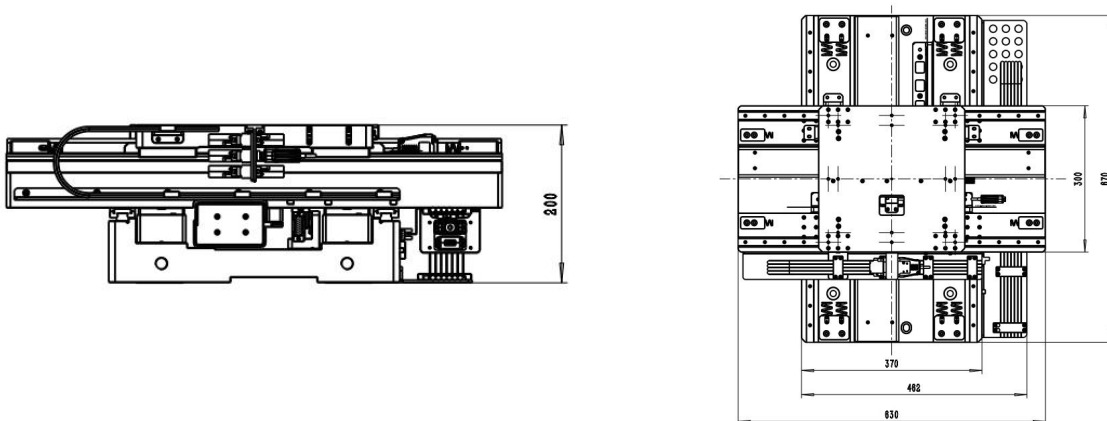
高真空精密二维位移台采用了符合超高真空标准的材料和1S06洁净室中的特殊工艺制造，确保可适用于105Pa及以下超高真空环境。在实现高精度、高刚度XY运动的同时，还保证了真空环境下的热管理与磁屏蔽需求，可广泛应用于电子束检测、电子束光刻、扫描电镜等场景。



### 产品特点

- 适用于10<sup>-6</sup>Pa及以下超高真空环境
- 低释气率、低发热真空直线电机驱动
- 独特的直线电机磁屏蔽设计
- 平台材料可选非磁性材料，整体漏磁可达nT级
- 优异的速度波动和位置稳定性

### 机械尺寸图



\*接口图纸为8英寸高真空电动精密二维位移台

## VLS200系列——高真空精密二维位移台

### 参数

	VLS200-08		VSL200-12	
	X	Y	X	Y
行程/Travel	300 mm	220 mm	400 mm	320 mm
最大速度/Max.Velocity	0.35 m/s			
最大加速度/Maximum Acceleration	0.4 g			
精度/Accuracy	±0.15 μm	±0.15 μm	±0.35 μm	±0.85 μm
双向重复精度/Bidirectional Repeatability	±0.1 μm	±0.1 μm	±0.2 μm	±0.2 μm
位置稳定性/Typical position stability (3σ)*	±5 nm	±5 nm	±2 nm	±2 nm
速度波动/Velocity Stability*	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%
直线度/Straightness	7.5 μm	7.5 μm	7.5 μm	7.5 μm
俯仰/Pitch	<15 arcsec	<15 arcsec	<20 arcsec	<20 arcsec
偏摆/Yaw	<10 arcsec	<10 arcsec	<10 arcsec	<10 arcsec
机械特征/Mechanical Specifications				
驱动负载（无负载）/Moving Mass (without payload)	52 Kg	7 Kg	53.5 Kg	9 Kg
最大负载/Max Load Capacity	13.5 Kg		13.5 Kg	
平台质量/Stage Mass	100 kg		145 kg	
外观尺寸/Dimension	670mm×630mm×200mm		810mm×714mm×200mm	
平台材料/Material	铝合金			

\*非主动减振环境下的测试数据。

### 定制信息

高真空精密二维位移台可选项：在真空产品序列里，配置了可根据用户实际应用选择的可选项。可选内容包括行程、编码器、控制系统等选项。行程可根据客户实际需求进行定制。

表1 导轨选项

-G1	常规真空导轨
-G2	无磁真空导轨